CLIPPEDIMAGE= JP410335830A

PAT-NO: JP410335830A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 10335830 A

TITLE: MULTILAYERED PRINTED WIRING BOARD AND MANUFACTURE

THEREOF

PUBN-DATE: December 18, 1998

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

HIRAMATSU, YASUJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME IBIDEN CO LTD COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP09161828 APPL-DATE: June 3, 1997

INT-CL (IPC): H05K003/46

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a multilayered printed wiring board of the IVH structure which can be manufactured efficiently with a high yield and also provide a method for manufacture thereof.

SOLUTION: A hole 40a is formed by a laser light in an insulating substrate 40, on which a metallic layer 42 is formed. The hole 40a is fled with a metal 46 to form a via hole 36a. Then, the metallic layer 42 is etched to form a conductor circuit 32a. After that, a projecting conductor 38a is foamed on the surface of the via hole 36a for making a single-sided circuit board 30A. The single-sided circuit board 30A and another single-sided circuit board 30B are stacked via an anisotropic conductive film 34A with the projecting conductor 38a of one board 30A located face to face with a conductor circuit 32b of the other board 30B and then are heated and pressed. The projecting conductor 38a is pressed against the anisotropic conductive film 34A, and thereby the via hole 36a and the conductor circuit 32b are electrically connected. Since it can be inspected whether there are defective points in the conductor circuit or other element of each board before stacking the single-sided circuit boards 30A, 30B, 30C, and 30D, only the free of defects single-sided circuit boards can be used in the stacking process.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-335830

(43)公開日 平成10年(1998)12月18日

(51) Int.Cl.⁶

H05K 3/46

識別記号

FΙ

H05K 3/46

N

G

K

審査請求 未請求 請求項の数3 FD (全 9 頁)

(21)出顧番号

(22)出廣日

特顧平9-161828

平成9年(1997)6月3日

(71)出顧人 000000158

イビデン株式会社

岐阜県大垣市神田町2丁目1番地

(72)発明者 平松 靖二

岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1-1 イビデ

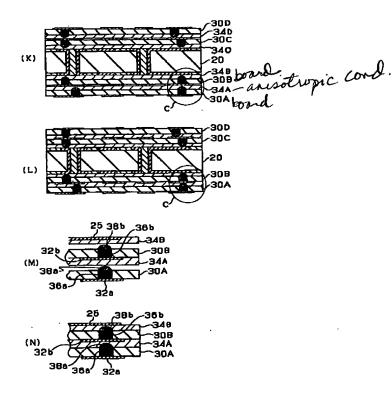
ン株式会社大垣北工場内

(74)代理人 弁理士 田下 明人 (外1名)

(54)【発明の名称】 多層ブリント配線板およびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 高い歩留りで効率良く製造できる I V H 構造 の多層プリント配線板およびその製造方法を提供する。 【解決手段】 金属層42が形成された絶縁基材40に 孔40 aをレーザ光にて形成する。該穴40 aに金属4 6を充填してバイアホール36aを形成する。そして、 金属層42をエッチングして導体回路32aを形成す る。バイアホール36aの表面に突起状導体38aを形 成して片面回路基板30Aとする。該片面回路基板30 Aの突起状導体38aと他の片面回路基板30Bの導体 回路32bを異方性導電フィルム34Aを介して積層 し、加熱加圧する。突起状導体38aは、該異方性導電 フィルム34Aを押圧し、該バイアホール36aと導体 回路32bと電気的に接続する。ここで、片面回路基板 30A、30B、30C、30Dを積層する前に、導体 回路等の不良個所の有無を検査することができるので、 積層段階では、不良のない片面回路基板のみを用いるこ とができる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 絶縁性基材の一方の面に導体回路を形成 してなり、かつ前記絶縁性基材には金属を充填して形成 したバイアホールを有する片面回路基板を、導体回路を 有する基板と異方性導電フィルムを介して接続した多層 プリント配線板において、

前記基材の導体回路が形成された面の反対側のバイアホ ール表面には、突起が形成されてなり、この突起が異方 性導電フィルムを押圧し、該バイアホールと導体回路と を接続していることを特徴とする多層プリント配線板。 【請求項2】 以下の00~50の工程を少なくとも含む多 層プリント配線板の製造方法、

①一方の面に金属層が形成された絶縁性基材に、該金属 層に至る孔をレーザ光にて形成する工程、

②①で形成された孔に金属を充填してバイアホールを形 成する工程、

③金属層をエッチングして導体回路を形成する工程、

④バイアホール表面に突起状導体を形成して片面回路基 板とする工程、

6片面回路基板の突起状導体と他の基板の導体回路を異 20 方性導電フィルムを介して積層し、加熱加圧して突起状 導体を異方性導電フィルムに押圧せしめ、前記バイアホ ールを導体回路に接続させるとともに、該片面回路基板 と当該他の基板とを一体化する工程。

【請求項3】 以下の〇一〇の工程を少なくとも含む多 層プリント配線板の製造方法、

①一方の面に金属層が形成された絶縁性基材に、該金属 層に至る孔をレーザ光にて形成する工程、

②①で形成された孔に金属を充填して突起を有するバイ アホールを形成する工程、

③金属層をエッチングして導体回路を形成して片面回路 基板とする工程、

④片面回路基板の前記突起と他の基板の導体回路を異方 性導電フィルムを介して積層し、加熱加圧して該突起を 異方性導電フィルムに押圧せしめ、前記バイアホールを 導体回路に接続させるとともに、該片面回路基板と当該 他の基板とを一体化する工程。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、多層プリント配 40 線板とその製造方法に関し、特には、インターステシャ ルバイアホール (IVH) 構造を有する多層プリント配 線板とその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来の多層プリント配線板は、銅張積層 板とプリプレグを交互に積み重ねて一体化してなる積層 体にて構成されている。この積層体は、その表面に表面 配線パターンを有し、層間絶縁層間には内層配線パター ンを有する。これらの配線パターンは、積層体の厚さ方 向に穿孔形成したスルーホールを介して、内層配線パタ 50 さなければならず、製造工程が複雑になり、製造に長時

ーン相互間あるいは内層配線パターンと表面配線パター ンとの間で電気的に接続されている。

【0003】ところが、上述したようなスルーホール構 造の多層プリント配線板は、スルーホールを形成するた めの領域を確保する必要があるために、部品実装の高密 度化が困難であり、携帯用電子機器の超小型化や狭ピッ チパッケージおよびMCMの実用化の要請に十分に対処 できないという欠点があった。そのため、最近では、上 述のようなスルーホール構造の多層プリント配線板に代 10 えて、高密度化に対応し易いインターステシャルバイア ホール (IVH) 構造を有する多層プリント配線板が注 目されている。

【0004】このIVH構造を有する多層プリント配線 板は、積層体を構成する各層間絶緑層に、導体層間を接 続する導電性のバイアホールが設けられている構造のプ リント配線板である。即ち、この配線板は、内層配線パ ターン相互間あるいは内層配線パターンと表面配線パタ ーン間が、配線基板を貫通しないバイアホール (ベリー ドバイアホールあるいはブラインドバイアホール)によ って電気的に接続されている。それ故に、IVH構造の 多層プリント配線板は、スルーホールを形成するための 領域を特別に設ける必要がなく、電子機器の小型化、高 密度化を容易に実現することができる。

【0005】こうしたIVH構造の多層プリント配線板 は、図7に示すような行程によって製造されている。ま ず、プリプレグ112としてアラミド不繊布にエポキシ 樹脂を含浸させた材料を用い、このプリプレグ112に 炭酸ガスレーザによる穴開け加工を施し、次いで、この ようにして得られた穴部分112aに導電性ペースト1 14を充填する(図7(A)参照)。

【0006】次に、上記プリプレグ112の両面に銅箔 116を重ね、熱プレスにより加熱、加圧する。これに より、プリプレグ112のエポキシ樹脂および導電性ペ ーストが硬化され両面の鋼箔116、116相互の電気 的接続が行われる(図7(B)参照)。

【0007】そして、上記銅箔116をエッチング法に よりパターニングすることで、バイアホールを有する硬 質の両面基板が得られる (図7 (C)参照)。このよう にして得られた両面基板をコア層として多層化する。具 体的には、上記コア層の両面に、上述の導電性ペースト を充填したプリプレグと銅箔とを位置合わせしながら順 次に積層し、再度熱プレスしたのち、最上層の銅箔11 6をエッチングすることで4層基板を得る(図7

(D)、(E)参照)。さらに多層化する場合は、上記 の工程を繰り返し行い、6層、8層基板とする。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し た従来技術は、熱プレスによる加熱、加圧工程とエッチ ングによる銅箔のパターンニング工程とを何度も繰り返

30

間を要することである。しかも、このような製造方法に よって得られるIVH構造の多層プリント配線板は、銅 箔のパターンニング不良を製造過程で確認することが難 しいために、製造過程で1個所でも(一工程でも)前記 パターンニング不良が発生すると、最終製品である配線 板全体が不良品となる。

【0009】つまり、上記従来の製造プロセスは、各積 層工程のうち1個所でも不良品を出すと、他の良好な積 層工程のものまで処分しなければならず、製造効率ある いは製造歩留りの悪化を招きやすいという致命的な欠点 10 があった。

【0010】本発明は、上述した課題を解決するために なされたものであり、その目的とするところは、高い歩 留りで効率良く製造できる I VH構造の多層プリント配 線板およびその製造方法を提供することにある。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達 成するため以下のように構成できる。

①一方の面に金属層が形成された絶縁性基材に、該金属 層に至る孔をレーザ光にて形成する工程、

②①で形成された孔に金属を充填してバイアホールを形 成する工程、

③金属層をエッチングして導体回路を形成する工程、

Φバイアホール表面に突起状導体を形成して片面回路基 板とする工程、

5片面回路基板の突起状導体と他の基板の導体回路(片 面回路基板であってもよい)を異方性導電フィルムを介 して積層し、加熱加圧して突起状導体を異方性導電フィ ルムに押圧せしめ、バイアホールを該異方性導電フィル ムを介して導体回路に接続させるとともに、該片面回路 30 板である。 基板と当該他の基板とを一体化する工程。

【0012】また、本発明は、上記目的を達成するため 以下のように構成できる。

①一方の面に金属層が形成された絶縁性基材に、該金属 層に至る孔をレーザ光にて形成する工程、

②①で形成された孔に金属を充填して突起を有するバイ アホールを形成する工程、

③金属層をエッチングして導体回路を形成して片面回路 基板とする工程、

④片面回路基板の突起と他の基板の導体回路(片面回路 40) 基板であってもよい)

を異方性導電フィルムを介して積層し、加熱加圧して該 突起を異方性導電フィルムに押圧せしめ、前記バイアホ ールを該異方性導電フィルムを介して導体回路に接続さ せるとともに、該片面回路基板と当該他の基板とを一体 化する工程。

【0013】本発明の多層プリント配線板およびその製 造方法によれば、所定の配線パターンを形成した導体回 路を有する片面回路基板が、予め個々に製造される。こ のため、該片面回路基板を積層する前に、導体回路等の 50 る。該導体回路32bとバイアホール36bを介して接

不良個所の有無を検査することができるので、積層段階 では、不良のない片面回路基板のみを用いることが可能 となる。即ち、本発明の製造方法においては、製造段階 での不良発生が少なくなり、IVH構造の多層プリント 配線板を高い歩留まりで製造できる。

【0014】また、本発明の多層プリント配線板の製造 方法は、従来技術のようにプリプレグを積み重ねながら 熱プレスを繰り返す必要がない。即ち、本発明では、片 面回路基板を複数枚重ねて、該片面回路基板に配設され た異方性導電フィルムを介して、1度に熱プレスするこ とができる。このため、本発明の製造方法では、複雑な 熱プレス行程を繰り返す必要がなく、IVH構造の多層 プリント配線板を短時間で効率良く製造することができ る。さらに、1回のプレスにより物理的な力で一体化し ているため、接続信頼性にも優れている。

【0015】なお、本発明の製造方法では、絶縁性基板 にバイアホール用の穴の穿設は、レーザにより行うこと が望ましい。これは、片面回路基板のバイアホールは、 多層プリント配線板を高密度化する上で微細且つ高精度 20 で形成することが有利であり、レーザによって、微細な 穴を容易に高精度で形成することができるからである。 [0016]

【発明の実施の形態】以下本発明の実施態様に係る多層 プリント配線板およびその製造方法について図を参照し て説明する。図1は、本発明の第1実施態様に係る多層 プリント配線板の縦断面を示している。多層プリント配 線板10は、中央に配設されたコア基板20と、該コア 基板20の上面及び下面に2層ずつ配設された片面回路 基板30A、30B、30C、30Dとから成る積層基

【0017】該片面回路基板30A、30B、30C、 30Dの一方の面には、所定のパターンの導体回路32 a、32b、32c、32dが形成されており、他方の 面には、異方性導電フィルム34A、34B、34C、 34Dが配設されている。該異方性導電フィルム34 A、34B、34C、34Dを介して、コア基板20と 片面回路基板30A、30B、30C、30Dとが接着 されている。各片面回路基板30A、30B、30C、 30Dには、導電性金属ペーストの充填されたブライン ドバイアホール36a、36b、36c、36dが形成 されており、該バイアホールの上部には、ハンダから成 るバンプ38a、38b、38c、38dが形成されて

【0018】即ち、多層プリント配線板10において は、最下層の片面回路基板30Aの導体回路32aは、 バイアホール36aを介してバンプ38aに接続されて いる。該バンプ38aは、上面の異方性導電フィルム3 4Aを押圧しており、該異方性導電フィルム34Aを介 して片面回路基板30Bの導体回路32bと接続され

望ましい。

(PI) などのフィルムから選ばれる1種であることが

続されたバンプ38bは、上面の異方性導電フィルム3 4Bと介してコア基板20のスルーホール24との導通 が取られている。該コア基板20のスルーホール24 は、上面側の片面回路基板30Cの異方性導電フィルム 34Cを介してバンプ38cと接続されている。該バン プ38 cとバイアホール36 cを介して接続された導体 回路32cは、最上面の片面回路基板30Dの異方性導 電フィルム34Dを介してバンプ38dと接続されてい る。該バンプ38 dは、バイアホール36 d介して導体 回路32dと接続されている。該最上面の片面回路基板 30Dには、ICパッケージ12及びベアチップ16が 配設され、該片面回路基板30Dの導体回路32d、3 2 dにハンダ14を介して接続されている。このよう に、多層プリント配線板の最下層の片面回路基板30A の導体回路32aと、最上層の片面回路基板30Dの導 体回路32上のチップ部品12、16とが、ブラインド バイアホール36a、36b、36c、36dを介して 接続されている。これら、バイアホールは、インタース テシャルバイアホールを構成する。

【0019】引き続き、該多層プリント配線板10の製 20 造方法について説明する。 ここでは、 先ず、 コア基板 2 0の製造方法について図2を参照して述べる。図2の行 程 (A) に示すようにBT (ビスマレイドミドートリア ジン) 樹脂製の基板22の両面に銅箔21を貼付た銅張 積層板を出発材とする。 行程 (B) に示すように、該基 板22にスルーホール用の穴22aを穿設した後、無電 解めっき処理を施し、該穴22a内に銅めっきを施すこ とによりスルーホール24を形成する。 行程 (C) に示 すように、予め図示しないエッチングレジストを塗布し た後、エッチング処理を施し、銅箔21の不要部分を除 30 去することで、所定の導体回路25を形成する。 行程 (D) に示すよう、該導体回路25及びスルーホール2 4の表面に黒化-還元処理を施して粗化する。行程

(E) に示すように、充填樹脂26をロールコータによ り均一に塗布し、該充填樹脂を硬化させた後、該充填樹 脂をベルトサンダー等で導体回路25が表面に露出する まで研磨し、両面が平坦なコア基板20を製造する。

【0020】該コア基板20は、スルーホール24の内 部、及び、導体回路25の側面25aが粗化され、導体 回路25と充填樹脂26との接着性が改善されている。 このため、該導体回路25と充填樹脂26との界面を起 点として図1を参照して上述した異方性導電フィルム3 4で、クラックの発生するのを防止できる。

【0021】引き続き、図3、図4を参照して片面回路 基板30の製造方法について説明する。 図3の行程 (A) に示すように、片面に金属層42の形成された絶 縁基材40を出発材とする。ここで、使用する絶縁基材 40としては、ガラスエポキシ基材、アラミド繊維ーポ リイミド基材、ビスマレイミドトリアジン樹脂基材、ポ リフェニレンエーテル (PPE) フィルム、ポリイミド 50 32aを形成する。ここでは、先ず、ドライフィルムを

【0022】また、絶縁基材40に形成された金属層4 2は、銅箔、ニッケル箔、アルミ箔などを使用できる。 銅箔は密着性改善のため、マット処理されていてもよ い。ここでは、片面銅張積層板を使用することがコスト 的には最も有利である。絶縁基材40の厚さは40~6 Oμmがよい。絶縁性を確保するためである。一方、金 属層42の厚さは、12~18μmがよい。これは、後 述するようにレーザにて孔明けする際に、薄すぎると貫 通してしまうからであり、逆に厚すぎるとエッチングし た際に、導体回路を形成し難いからである。

【0023】ついで、レーザで樹脂絶縁基材40に孔4 Oaを開ける(行程(B))。レーザは、炭酸ガスレー ザ、UVレーザ、エキシマレーザなどを使用できる。ま た、孔径は50~150µmがよい。炭酸ガスレーザ は、安価であり工業的に用いるには最も適しており、本 願発明に最も望ましいレーザである。ここで、炭酸ガス レーザを用いた場合には、該穴40a内であって、金属 層42の表面にわずかながら溶融した樹脂が残るため、 デスミア処理を行うことが好ましい。

【0024】引き続き、レーザで開けた孔40aに金属 46を充填してバイアホール36aとする(行程

(E))。ここで、金属46の充填は、導電性ペースト を充填したり、或いは、電解めっきにより行う。導電性 ペーストは、銀、銅、金ペーストから選ばれる少なくと も1種を使用できる。一方、レーザにて孔径50µm以 下の微細径を穿設したは、金属ペーストを充填すること は困難であるため、電解めっきの方が実用的である。

【0025】電解めっきにより充填する場合は、絶縁基 材40に形成された金属層42をめっきリードとして電 解めっきを行う。ここで、電解めっき前に、孔40a内 の金属層42の表面を酸などで活性化処理しておくとよ い。めっきを行う際には、絶縁基材40に形成された金 属層42の表面側に電解めっきが析出しないように、行 程(C)に示すよう金属層42側にマスク48をかけて おくか、或いは、行程(D)に示すように同じ絶縁基材 40を2枚、金属層42同士を積層密着させてめっき液 に触れないようにして、電解めっきを行う。

40 【0026】電解めっき後、図4の行程(F)に示すよ うに孔40 aから盛り上がっためっき膜(金属46)を 研磨などで除去する。研磨は、ベルトサンダーやバフ研 塵等を使用できる。

【0027】行程(G)に示すように、金属層42をエ ッチングして導体回路を形成するための前処理として、 まず、金属層42全体をエッチングして厚さを1-5μ m程度まで薄くする。これにより、パターンを形成し易 くなる。 行程 (H) に示すように、 所定パターンのマス クを被覆した後、金属層42をエッチングして導体回路 貼付し、所定の回路パターンに沿って露光、現像処理し てエッチングレジストを形成した後、エッチングレジス ト非形成部分をエッチングする。エッチングは、硫酸-過酸化水素、過硫酸塩、塩化第二銅、塩化第二鉄の水溶 液から選ばれる少なくとも1種がよい。

【0028】なお、導体回路32aの表面は、粗化処理 しておくことが望ましい。 図1を参照して上述した異方 性導電フィルム34との密着性を改善し、クラックの発 生や剥離を防止するためである。粗化処理は、黒化(酸 化) - 還元処理や銅ーニッケルーリンからなる針状合金 10 めっき(荏原ユージェライト製 商品名インタープレー ト)の形成、メック社製の商品名「メック エッチボン ド」なるエッチング液による表面粗化がよい。

【0029】次に、行程(I)にて、導体回路32aを 形成した面とは反対側で、バイアホール36aの表面に 突起状導体(バンプ)38aを形成する。突起状導体3 8 aは、 導電性 (ハンダ) ペーストを所定位置に開口の 設けられたメタルマスクを用いてスクリーン印刷した り、或いは、半田めっきを行うことにより形成する。

【0030】この状態で、導体回路32aとバンプ38 aとに接続不良が無いか、及び、導体回路32a相互間 の絶縁が取れているかを検査する。上述したように従来 技術の多層プリント配線板では、積層して完成後でなけ れば、導体回路の検査を行えなかったのに対して、本実 施態様では、片面回路基板30Aを、積層する前に不良 個所の有無を検査することができるので、後述する積層 段階では、不良のない片面回路基板30Aのみを用いる ことができる。

【0031】最後に、行程(J)に示すように、該絶縁 基材40の突起状導体(バンプ)38a側表面、又は、 導体回路32b、25,32c側表面に、未硬化の異方 性導電フィルム34Aをラミネートする。特に、導体回 路326、25、32cに粗化層を形成した場合は、導 体回路我にラミネートした方がよい。異方性導電フィル ムの厚さは、10~50μm が望ましい。

【0032】引き続き、図2を参照しで上述したコア基 板20と、図3及び図4を参照して上述した片面回路基 板30との積層行程について図5を参照して説明する。 行程(K)に示すように、該片面回路基板30Aと、上 述したと同様な行程で形成された片面回路基板30B、 30C、30Dと、コア基板20とを重ねる。ここで、 全ての片面回路基板30A、30B、30C、30D、 及びコア基板20は、不良個所の検査が済んだものを用 いる。先ず、片面回路基板30Aの異方性導電フィルム 34Aの上に片面回路基板30Bを、又、該片面回路基 板30Bの異方性導電フィルム34Bの上にコア基板2 0を載置する。ここで、該コア基板の上には、片面回路 基板30C、30Dを反転、即ち、片面回路基板30C の異方性導電フィルム34℃が該コア基板20個へ向 き、又、片面回路基板30Dの異方性導電フィルム34 50 り、該バイアホール36aの突起部37と導体回路32

Dが該片面回路基板30C側に向くように重ね合わせ る。この重ね合わせは、片面回路基板30及びコア基板 20の周囲に設けられたガイドホール (図示せず)をガ イドピン (図示せず) に挿通することで位置合わせしな がら行う。ここで、積層された基板の図中サイクルCの

部分を拡大して(M)として示す。 【0033】最後に、行程(L)に示すように、重ね合 わせた基板を、熱プレスを用いて150~180℃で加 熱し、 $20\sim50$ kg f / c m² で加圧することによ り、各片面回路基板30A、30B、30C、30D を、1度のプレス成形により多層状に一体化する。積層 された基板の図中サイクルCの部分を拡大して(N)と して示す。ここでは、先ず、加圧されることで、該片面 回路基板30Aのバンプ38aが、該バンプ38aと片 面回路基板30B側の導体回路32bとの間に介在して いる異方性導電フィルム34Aを押圧し、他の部分の絶 縁性を保ちながら該押圧部分のみを導電性にする。これ により、該バンプ38aと導体回路32bとの電気的な 接続を取る。同様に他の片面回路基板30B、30C、 30Dのバンプ38b、38c、38d (図1参照) と 異方性導電フィルム34B、34C、34Dを介して導 体回路との接続が取られる。更に、加圧と同時に加熱さ れることで、片面回路基板30Aの異方性導電フィルム 34が硬化し、片面回路基板30Bとの間で強固な接着 が行われる。なお、熱プレスとしては、真空熱プレスを 用いることが好適である。これにより図1を参照して上 述した多層プリント配線板10が完成する。

【0034】引き続き、本発明の第2実施態様につい て、図6を参照して説明する。上述した実施態様では、 図3に示す行程(E)にて孔40aに金属46を充填し た後、図4の行程(F)に示すように孔40 aから盛り 上がっためっき膜(金属46)を研磨して除去した。こ れに対して、第2実施態様においては、該バイアホール 36 aの盛り上がった突起部をそのまま用いる。

【0035】 先ず、 図6に示す行程 (A) のように、 片 面回路基板30Aの上層となる片面回路基板30Bの導 体回路32bの上に、第1実施態様と同様に異方性導電 フィルム34Aをラミネートする。その後、行程(B) に示すように、片面回路基板30A、30B、30C、 40 30Dと、コア基板20とを重ねる。最後に、行程 (C) に示すように、重ね合わせた基板を、熱プレスを 用いて150~180℃で加熱し、20~50kgf/ cm² で加圧することにより、各片面回路基板30A、 30B、30C、30Dを多層状に一体化する。ここで は、先ず、加圧されることで、該片面回路基板30Aの バイアホール aの突起部37が、該突起部37と片面回 路基板30B側の導体回路32bとの間に介在している 異方性導電フィルム34Aを押圧し、他の部分の絶縁性 を保ちながら該押圧部分のみを導電性にする。これによ

る。

10 構造の多層プリント配線板を高い歩留まりで製造でき

bとの電気的な接続を取る。同様に他の片面回路基板3 0B、30C、30Dの突起部37と異方性導電フィル ム34B、34C、34Dを介して導体回路との接続が 取られる。更に、加圧と同時に加熱されることで、片面 回路基板30Aの異方性導電フィルム34が硬化し、片 面回路基板30Bとの間で強固な接着が行われる。これ により第2実施態様の多層プリント配線板が完成する。

【0036】この第2実施態様の製造方法は、第1実施 態様と比べて、行程を削減できる利点がある。他方、第 後に、バンプを形成するため、該バンプの高さを一定に 保ち易く、異方性導電フィルム34に均一な力を加える ことで、接続不良を発生し難い利点がある。

【0037】上述した実施熊様では、4層の片面回路基 板30が重ね合わされた多層プリント配線板について説 明したが、3層あるいは5層以上の多層プリント配線板 にも本発明の構成を適用できる。更に、従来技術の方法 で作成された片面プリント基板、両面プリント基板、両 面スルーホールプリント基板、多層プリント基板に本発 明の片面回路基板を積層して多層プリント配線板を製造 20 することもできる。

【0038】また、上述した実施態様では、バイアホー ルを形成するための穴をレーザを用いて形成したが、ド リル加工、パンチング加工等の機械的方法で穴開けする ことも可能である。

【0039】更に、本発明の多層プリント配線板を構成 する片面回路基板は、異方性導電フィルムを介して他の 片面回路基板及びコア基板と接着されている。片面回路 基板を接着する基板としては、従来から知られている種 々のプリント配線基板を使用することができる。

【0040】また、本発明の多層プリント配線板は、プ リント配線板に一般的に行われている種々の加工処理、 例えば、表面へのソルダーレジストの形成、表面の導体 回路へのニッケル/金めっきやハンダ処理、穴開け加 工、キャビティー加工、スルーホールめっき処理等を施 すことができる。

[0041]

【発明の効果】以上のように、本発明によれば、所定の 配線パターンを形成した導体回路を有する片面回路基板 が、予め個々に製造される。このため、該片面回路基板 40 40 絶縁基材 を積層する前に、導体回路等の不良個所の有無を検査す ることで、積層段階では、不良のない片面回路基板のみ を用いることが可能となる。即ち、本発明の製造方法に おいては、製造段階での不良発生が少なくなり、IVH

【0042】また、本発明の多層プリント配線板の製造 方法は、従来技術のようにプリプレグを積み重ねながら 熱プレスを繰り返す必要がない。即ち、本発明では、片 面回路基板を複数枚重ねて、該片面回路基板に配設され た異方性導電フィルムを介して、1度に熱プレスするこ とができる。このため、本発明の製造方法では、複雑な 熱プレス行程を繰り返す必要がなく、IVH構造の多層 1実施態様の方法は、バイアホールの表面を平滑化した 10 プリント配線板を短時間で効率良く製造することができ る。さらに、1回のプレスにより物理的な力で一体化し ているため、接続信頼性にも優れている。

【図面の簡単な説明】

【図1】発明の第1実施態様に係る多層プリント配線板 の縦断面図である。

【図2】発明の第1実施態様に係る多層プリント配線板 を構成するコア基板の製造工程図である。

【図3】発明の第1実施態様に係る多層プリント配線板 を構成する片面回路基板の製造工程図である。

【図4】発明の第1実施態様に係る多層プリント配線板 を構成する片面回路基板の製造工程図である。

【図5】発明の第1実施態様に係る多層プリント配線板 の製造工程図である。

【図6】発明の第2実施態様に係る多層プリント配線板 の製造工程図である。

【図7】従来技術に係る多層プリント配線板の製造工程 図である。

【符号の説明】

10 多層プリント配線板

30 20 コア基板

24 スルーホール

25 導体回路

30A、30B、30C、30D 片面回路基板

32a、32b、32c、32d 導体回路

34A、34B、34C、34D 異方性導電フィルム 36a、36b、36c、36d バイアホール

37 突起部

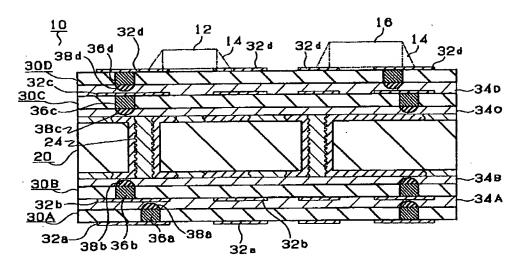
38a、38b、38c、38d バンプ (突起状導 体)

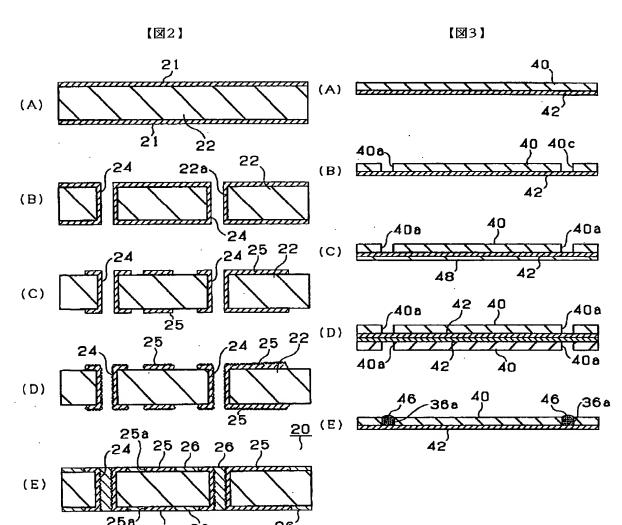
40a 穴

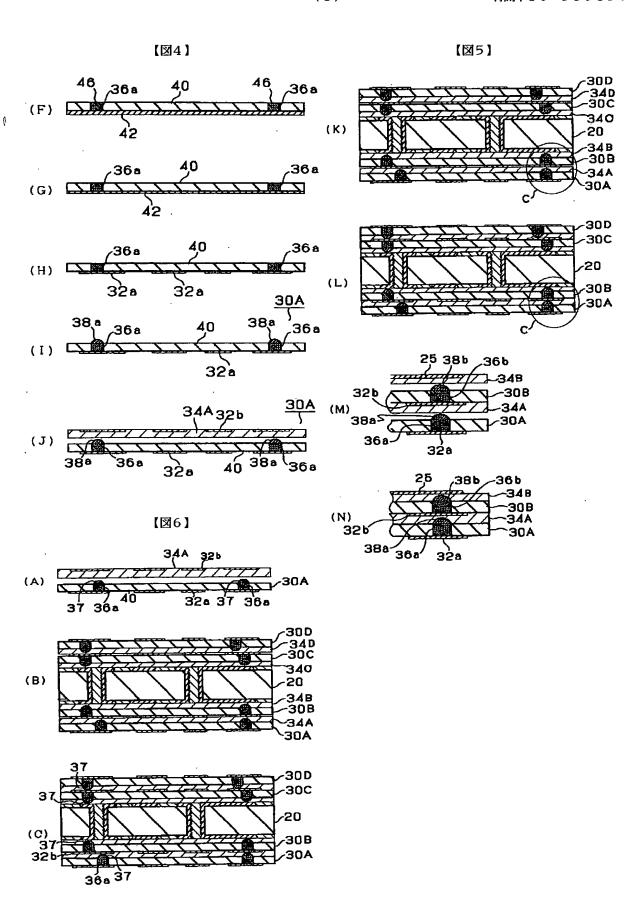
42 金属層

46 金属

【図1】







【図7】

